

REC'D 2 8 DEC 2004

PA 1254355

ON REPORTED STRAFFS (DEFENDED)

<u>TO MILTO WHOM THUSE: PRESENTS SHAML COMES</u>

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE

United States Patent and Trademark Office

December 02, 2004

THIS IS TO CERTIFY THAT ANNEXED HERETO IS A TRUE COPY FROM THE RECORDS OF THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE OF THOSE PAPERS OF THE BELOW IDENTIFIED PATENT APPLICATION THAT MET THE REQUIREMENTS TO BE GRANTED A FILING DATE UNDER 35 USC 111.

APPLICATION NUMBER: 60/586,735

FILING DATE: July 12, 2004

PRIORITY DOCUMENT

COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

By Authority of the

COMMISSIONER OF PATENTS AND TRADEMARKS

Certifying Officer

PROVISIONAL PATENT APPLICATION

ATTORNEY DOCKET NO.:

120391

DATE: July 12, 2004

MAIL STOP PROVISIONAL PATENT APPLICATION

PROVISIONAL PATENT APPLICATION **RULE §1.53(c)**

Commissioner for Patents P.O. Box 1450 Alexandria, VA 22313-1450

Customer Number: 25944

Sir:	
Transmitted herewith for filing under 37 CFR §1.53(c) is the provisional patent application of	
FIRST INVENTOR:	Dr. Daniel KOPF
RESIDENCE:	Altach, Austria (City and Either State or Foreign Country)
SECOND INVENTOR:	Dr. Maximillian Josef LEDERER
RESIDENCE:	Alberschwende, Austria (City and Either State or Foreign Country)
THIRD INVENTOR:	Uwe MORGNER
RESIDENCE:	Rhein, Germany (City and Either State or Foreign Country)
FOR (TITLE):	DIODE-PUMPED ULTRASHORT PULSE LASER OSCILLATOR WITH
	CAVITY DUMPING
 ☐ This patent application ☐ The executed A ☐ Entitlement to small ☐ Check No. 156117 in Except as otherwise additional filing fees 	gs. 1-8; sheets 4) are attached. on is assigned to HIGH Q LASER PRODUCTION GmbH. assignment is filed herewith. entity status is hereby asserted. In the amount of \$\sumsymbol{\sum}\sumsymbol{\sum}\sims\sim}\sims\sim\sim\sim\sim\sim\sim\sim\sim\si

Respectfully submitted,

Registration No. 27

Joel S. Armstrong Registration No. 36,430

JAO:JSA/emt

Diode-pumped ultrashort pulse laser oscillator with cavity dumping

Die Erfindung betrifft ein diodengepumptes Lasersystem nach 5 dem Prinzip der Puls-Auskopplung zur Erzeugung von ultrakurzen Pulsen.

Bekannte Ultrakurzpuls-Lasersysteme werden zwar in einer z.B. genutzt, . wie Anwendungen von Vielzahl Biomedizin oder Mikroskopie, Materialverarbeitung, 10 Herstellung photonischer Komponenten. Allerdings ist der Einsatz ausserhalb eines Laborbetriebs oft problematisch, da die Laser-Systeme eine grosse Komplexität und einen hohen Handhabungsaufwand bedingen. Zusätzlich zur hohen Energie der Femtosekundenpulse spielt für den industriellen 15 Einsatz insbesondere die Kompaktheit der Lasersysteme eine wesentliche Rolle.

Laseranordnungen nach dem Prinzip der Pulsauskopplung oder
20 des Cavity-Dumpers erlauben die Erzeugung von Pulsen,
welche für die Anwendung im Bereich der Mikrostrukturierung
erforderliche Energien bzw. Pulsspitzenleistungen besitzen.
Dabei kann auf die Verwendung von komplexen
Verstärkeranordnungen verzichtet werden, was zu einem
25 kompakten Aufbau führt.

Ein Lasersystem nach dem Prinzip des Puls-Auskopplers oder Cavity Dumpers mit Pulsenergien von bis zu 100 nJ ist beispielsweise aus M. Ramaswamy, M. Ulman, J. Paye, J.G. Fujimoto, "Cavity-dumped femtosecond Kerr-lens mode-locked Ti:Al₂O₃ laser", Optics Letters, Vol. 18, No. 21, 1. November 1993, Seiten 1822 bis 1824 bekannt. Dieses Dokument wird als durch Referenzierung in diese Anmeldung einbezogen

betrachtet. Ein modengekoppelter Ti:Al2O3 Laser wird zur Erzeugung von 50 Femtosekunden-Pulsen mit einer Energie von 100 nJ bzw. Pulsspitzenleistungen von 0,1 MW und einer einstellbaren Rate bis zu 950 kHz mit einem akusto-optischen Schalter als Cavity-Dumper betrieben. Der Schalter selbst besteht aus einer Quarz-Zelle, auf die im Brewster-Winkel der Laserstrahl mit einem Spiegel fokussiert wird. Zum Pumpen wird ein Argon-Laser und zur Dispersionskompensation eine nachgelagerte Strecke mit 4 Prismen verwendet.

10

In A. Baltuška, Z. Wie, M.S. Pshenichniko, D.A. Wiersma, Robert Szipöcs, "All-solid-state cavity-dumped sub-5-fslaser", Appl. Phys. B 65, 1997, Seiten 175 bis 188 ist ein dem nach dem Festkörper-Lasersystem beschrieben, mit Prinzip des Cavity-Dumpers Laserpulse einer Dauer von unter 15 5 Femtosekunden erzeugt werden. Dieses Dokument wird als Anmeldung einbezogen diese Referenzierung in durch betrachtet. Das verwendete Ti:Saphir-Lasermedium wird durch frequenzverdoppelten diodengepumpten, wiederum einen 20 Festkörperlaser mit Nd:YVO4 als Lasermedium gepumpt. Die Ausbildung als Cavity-Dumper erfolgt durch eine Bragg-Zelle als akusto-optischem Schalter. Diese Anordnung erfordert Kavität, sorgfältiges Design der ein Modenkopplung durch Kerr-Linseneffekt nicht bereits durch Dispersion des akusto-optischen Modulators gestört 25 Eine mögliche Verwendung von elektro-optischen wird. wobei allerdings erwähnt, wird Modulatoren Beschränkung auf erzielbare Repetitionsraten von ungefähr beschriebenen Mit dem hervorgehoben wird. kHz mit einer sub-5-fs-Pulse Lasersystem sollen 30 einer und Megawatt 2 Pulsspitzenleistung von Repetitionsrate von 1 MHz realisiert werden.

Einen hochrepetierenden Laser mit Cavity-Dumping und einem elektro-optischen Schalter beschreibt E. Krüger in "Highrepetition-rate electro-optic cavity dumping", Rev. Sci. Instrum. 66 (2), Februar 1995, Seiten 961 bis 967. Dieses Dokument wird als durch Referenzierung in diese Anmeldung einbezogen betrachtet. Als Basis der Anordnung dient ein durch einen Argon-Laser synchron gepumpter modengekoppelter Farbstofflaser, wobei als Schalter eine LM 20 Pockels-Zelle KD*P-Kristallen deuterierten aus zwei Dünnschichtpolarisator Verwendung finden. Das Lasermedium besteht aus einer Lösung von Rhodamin 6G in Ethylenglykol. Die erzeugten Pulse besitzen eine Dauer von 15 Nanosekunden bei einer mittleren ausgekoppelten Leistung von 75 mW und einer Repetitionsrate von 10 MHz.

15

20

10

Ein Laser nach dem Cavity-Dumper-Prinzip mit elektrooptischem Schalter zeigt V. Kubecek, J. Biegert, J.-C.
Diels, M.R. Kokta, "Practical source of 50 ps pulses using
a flashlamp pumped Nd:YAG laser and passive all-solid-state
pulse control", Optics Communications 177 (2000), Seiten
317 bis 321. Dieses Dokument wird als durch Referenzierung
in diese Anmeldung einbezogen betrachtet. Ein Nd:YAGLasermedium wird durch eine Blitzlampe gepumpt. Als
elektro-optischer Schalter findet eine Pockels-Zelle mit
dielektrischem Polarisator Verwendung. Die erzielbaren
Energien der 50-Pikosekunden-Pulse werden mit 300 μJ bei
Repetitionsraten von 5 Hz angegeben, wobei eine Kompression
einzelner Pulse innerhalb der Kavität erfolgt.

30 Ti:Al₂O₃-Laser liegen damit in den erzielbaren Pulsspitzenleistungen zwar über den Farbstofflasern. Allerdings wird die erreichbare Pulsenergie durch die Verwendung der akusto-optischen Modulatoren eingeschränkt, da für diese der Effekt der Selbstphasenmodulation wegen der benötigten kleinen Fokusse zu hoch wird, was in Pulsinstabilitäten oder auch Zerstörung des Modulatormaterials resultieren kann. Ausserdem erfolgt bei Farbstofflasern eine zeitliche Degradation des Lasermediums und das Pumpen durch Blitzlampen oder Festkörperlaser führt zu komplexen Systemen.

Gattungsgemässe Lasersysteme des Stands der Technik sind somit durch ihren Aufbau und die verwendeten Komponenten zu komplex und/oder in der erreichbaren Pulsenergie limitiert bzw. erreichen keine Pulsdauern im Femtosekundenbereich.

Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht in der
15 Bereitstellung eines kompakten Lasersystems, insbesondere
eines diodengepumpten Lasersystems nach dem Prinzip der
Pulsauskopplung, welches ultrakurze Pulse mit einer
Repetitionsrate grösser als 10 kHz und Pulsenergien über
100 nJ erzeugt.

20 .

25

30

Eine weitere Aufgabe besteht in der Bereitstellung eines kompakten Lasersystems, insbesondere ohne Elemente zur Pulsverstärkung ausserhalb der Kavität, mit einer Pulsspitzenleistung grösser als 100 kW bei einer Repetitionsfrequenz grösser als 10 kHz.

Die Erfindung betrifft ein Lasersystem nach dem Prinzip der Pulsauskopplung, bei dem ein diodengepumpter Piko- oder Femtosekunden-Oszillator mit einem elektro-optischen Modulator als Schalter betrieben wird.

Ein Vorteil des EOM im Vergleich zum AOM besteht darin, dass der EOM mit sehr grossen Strahlquerschnitten betrieben

werden kann (z. B. d = 700mum), so dass höhere Energien möglich sind. Damit kann vermieden werden, dass es bei den zu erzeugenden Pulsleistungen bzw. Pulsenergien im Schalter Selbstphasenmodulation (SPM) exzessiver benötigt hingegen SiO2-AOM Ein kommt. Zerstörung typischerweise d < 50mum bei einer Modulatorlänge von 3 mm, um die gleiche Schaltflankenkurze zu erreichen. Es sind zwar längere Modulatorzellen erhältlich bei welchen die Fokusse grösser gehalten werden können. Jedoch verringert sich dabei wegen der Zunahme der Wechselwirkungslänge die angesammelte nichtlineare Phase nicht merklich. Zudem muß um mit dem EOM-Verfahren vergleichbare Schalteffizienzen zu der Michelson-Konfiguration der MOA in erreichen was einen vergleichsweise komplexen betrieben werden, Resonatoraufbau bedeutet.

Ausgang des Pulsauskopplers nun z. В. amWollte man Femtosekundenpulse mit 1 µJ Energie und 200 fs Pulsbreite erzeugen, so müsste innerhalb der Kavität typischerweise eine Pulsenergie von 2 µJ vorliegen. Diese Forderung resultiert aus der Notwendigkeit, dass der Betrieb des cavity dumped Lasers quasi-stationar sein muss, was bei hohen Repetitionsraten und Auskoppelgraden von > 50 % schwierig zu erreichen ist. Bei den genannten Querschnitten aufgrund der liesse sich MOA Leistungen im ' und Solitonenbedingung

$$\left|\beta_2\right| = \frac{\tau_{FWHM} \cdot E \cdot \kappa}{3.526} \tag{1}$$

30 mit

10

15

20

$$\kappa = \frac{4 \cdot l_{AOM} \cdot n_2}{\lambda_0 \cdot \omega_0^2} \tag{2}$$

ein 200 fs Soliton bei 1 µm Wellenlänge nur stabilisieren, wenn die hohe negative Netto-Dispersion von ca. -40000 fs² in den Resonator eingebracht werden würde. Hierbei bezeichnet

- $oldsymbol{eta}_2$ die resonatorinterne negative Nettodispersion,
- 10 au_{FWHM} die Halbwertsbreite der sech²-Solitonen,
 - E die Pulsenergie,
 - κ den Selbstphasenmodulationsparameter,

15

- $l_{\mbox{\scriptsize AOM}}$ die einfache Länge des akusto-optischen Modulators,
- n_2 den vom Kerr-Effekt herrührenden nichtlinearen Brechungsindex,
 - λ_{o} die Vakuumwellenlänge und
 - ω_{0} den Strahlradius im AOM.

25

30

Darüber hinaus verbleiben bei Vorliegen einer solchen Dispersion immer noch Probleme, da bei einmaligem Durchgang ein zu hoher Chirp entsteht und die Pulsparameter sich während eines Resonatorumlaufs zu stark ändern. Dies hat zur Folge, dass ein stationärer Solitonbetrieb nicht möglich ist und in der Regel dispersive Strahlung im

Resonator entsteht, welche dann zum Mehrfachpulsen oder dynamischer Unstabilität führt. Als Mass für eine diesbezügliche Neigung des Lasers lässt sich z. B. das Verhältnis r der Resonatorperiode und der Solitonenperiode definieren.

$$r = \frac{E \cdot \kappa \cdot 1,763}{\pi \cdot \tau_{\text{FWHM}} \cdot 1,134} \tag{3}$$

Für den stabilen Betrieb sollte dieses Verhältnis << 1
sein. Im obigen Fall läge der Wert bei ca. 3, was eindeutig
zu hoch ist. Die Grundlage dieser Berechnung kann F.
Krausz, M.E. Fermann, T. Brabec, P.F. Curly, M. Hofer, M.H.
Ober, C. Spielmann, E. Wintner, und A.J. Schmidt
"Femtosecond Solid-State Lasers" in IEEE Journal of Quantum
Electronics, Vol. 28, No. 10, Seiten 2097-2120, Oktober
1992 entnommen werden. Dieses Dokument wird als durch
Referenzierung in diese Anmeldung einbezogen betrachtet.

Für ein Femtosekunden-Lasersystem nach dem Prinzip der 20 Pulsaukopplung ist daher die Pulsenergie mit einem EOM einfacher skalierbar als mit einem AOM.

Die durch den EOM generierte Dispersion kann für typische Modulatormaterialien (z. B. BBO) und -längen relativ einfach durch eine Folge von dispersiven Komponenten, z.B. Spiegel, in der Kavität kompensiert werden. Die Anzahl der dispersiven Spiegel wird durch die zu kompensierende positive Dispersion in der Kavität, zu der alle Spiegel, das Lasermedium, der Dünnschichtpolarisator und der BBO-EOM mit einem Hauptanteil beitragen, sowie durch die Solitonenbedingung bestimmt. Letztere besagt, dass für eine bestimmte umlaufende Pulsenergie, einen Parameter der

Selbstphasenmodulation und einer zu erzielenden Pulsbreite eine bestimmte negative Netto-Dispersion in der Kavität herrschen muss. Aufgrund der hohen Strahlquerschnitte, welche beim EOM-Schalter möglich sind, wird der Parameter κ der Selbstphasenmodulation nur bestimmt durch den Strahlquerschnitt im Lasermedium und dessen nichtlinearen Brechungsindex n_2 .

Zur Dispersionskompensation können dispersive Spiegel, z.B.

10 Gires-Tournois-Interferometer, Verwendung finden, die somit
zur Kompensation der positiven Dispersion in der Kavität
und zur Erfüllung der Solitonenbedingung dienen.

Mit einer solchen Ausgestaltung eines Lasersystems nach dem
15 Prinzip der Pulsauskopplung wurden Femtosekundenpulse mit
einer Repetitionsfrequenz bis zu 1 MHz und einer
Pulsenergie von 500 nJ und damit mehr als 1 MW Leistung
erzeugt. Das Lasersystem wird dabei unter Verwendung der
dispersiven Spiegel und eines sättigbaren Absorberspiegels
20 modengekoppelt betrieben.

Ein Ausführungsbeispiel für ein erfindungsgemässes Lasersystem wird nachfolgend schematisch dargestellt und rein beispielhaft näher beschrieben. Im einzelnen zeigen

- Fig.1 die Darstellung eines ersten Ausführungsbeispiels des erfindungsgemässen Lasersystems im Femtosekundenbereich;
- 30 Fig.2 die Darstellung eines zweiten
 Ausführungsbeispiels des erfindungsgemässen
 Lasersystems im Pikosekundenbereich;

5

- Fig.3 die Darstellung des Verlaufs der Pulsenergie innerhalb der Kavität in Zeitabhängigkeit für eine Repetitionsfrequenz von 15 kHz in einer Femtosekunden-Anordnung;
- Fig.4 die Darstellung des Verlaufs der Pulsenergie innerhalb der Kavität in Zeitabhängigkeit für eine Repetitionsfrequenz von 173 kHz in einer Femtosekunden-Anordnung;
 - Fig.5 die Darstellung der Pulsevolution innerhalb der Kavität für eine Repetitionsfrequenz von 1 MHz in einer Pikosekunden-Anordnung;
- Fig.6 die Darstellung der Pulsevolution nach
 Auskopplung ausserhalb der Kavität für eine
 Repetitionsfrequenz von 1 MHz in einer
 Pikosekunden-Anordnung;
- Fig.7 die Darstellung der Pulsevolution innerhalb der
 Kavität für eine Repetitionsfrequenz von 100 kHz
 in einer Pikosekunden-Anordnung und
- 25 Fig.8 die Darstellung des Verlaufs der ausgekoppelten Energie in Abhängigkeit von der Frequenz der Auskopplung für Femto- und Pikosekunden-Anordnung.
- 30 In Fig.1 wird ein erstes Ausführungsbeispiel des erfindungsgemässen Lasersystems nach dem Prinzip der Pulsauskopplung für den Femtosekundenbereich dargestellt. Das Lasersystem basiert auf einer gefalteten Kavität in an

sich bekannter Ausführungsform. Als Lasermedium 11 wird Ytterbium gedoptes LG760 Glas verwendet, das mit einer mit 976 nm emittierenden Pumpdiode 9 über eine Kombination von zwei achromatischen Linsen 10 gepumpt wird. Die Linsen 10 besitzen Brennweiten von 30 mm bzw. 75 mm. Durch einen sättigbar absorbierenden Spiegel 14 und dispersive Spiegel 6a-d, 7a-g, 8a-i zur Erzeugung der notwendigen negativen Dispersion wird eine Soliton-Modenkopplung bewirkt. der exzessiven Selbstphasenmodulation eines Vermeidung akusto-optischen Modulators wird eine Beta-Barium-Borat elektro-optisches Element (BBO) - Pockels-Zelle als zur einem Dünnschichtpolarisator mit zusammen über eine welches verwendet, Pulsauskopplung Rechner 2 und einen Hochspannungsversorgung Schaltsignalgenerator 3 geschaltet wird. In Abhängigkeit der an das elektro-optische Element 1 angelegten Spannung wird die Polarisationsebene eines Laserstrahls dass über den Dünnschichtpolarisator 4 gedreht, so ausgekoppelt werden kann.

20

25

30

10

15

In der Kavität baut sich ein Puls aus dem Rauschen oder vorhergehenden Puls verbliebenen einem von einem Strahlungsfeld auf und wird bei jedem Durchgang durch das Lasermedium 11 verstärkt, wobei mehrfache Reflexionen an den dispersiven Spiegeln 6c-d, 7a-g, 8a-i erfolgen. Nach einer gewissen Anzahl von Resonatorumläufen und Durchgängen durch das verstärkende Lasermedium 11 wird der Puls durch eine Rotation der Polarisation mittels Schalten elektrooptischen Elements 1 über den Dünnschichtpolarisator als Laserpuls ausgekoppelt. Diese Anordnung lediglich ein Ausführungsbeispiel für eine Laseranordnung nach dem Prinzip der Pulsauskopplung dar.

- 11 -

Die einzelnen Komponenten der Laseranordnung in Fig.1 sind wie folgt bezeichnet

- elektro-optisches ElementHochspannungsversorgung
- 5 3 Schaltsignalgenerator
 - 4 Dünnschichtpolarisator
 - 5 Hochreflektor
 - 6a-d Dispersiver Planar-Spiegel
 - 7a-g Dispersiver Planar-Spiegel
- 10 8a-i Dispersiver gekrümmter Spiegel
 - 9 Pumpdiode
 - 10 Achromatische Linse
 - 11 Lasermedium
 - 12 Photodiode
- 15 13 Doppelbrechender Filter
 - 14 Sättigbar absorbierender Spiegel

Fig.2 zeigt einen diodengepumpten, SESAM-modengekoppelten Nd:YVO4-Pikosekundenlaser dem Prinzip nach 20 Pulsauskopplung mit EOM als zweites Ausführungsbeispiel des erfindungsgemässen Lasersystems. Das Lasersystem ähnelt der in Fig.1 dargestellten Anordnung und basiert ebenfalls auf gefalteten Kavität in sich bekannter einer an Ausführungsform, die in Fig.2 iedoch 25 Anschaulichkeitsgründen nicht explizit dargestellt ist. Als 11' wird teildurchlässigen Lasermedium mit einer Spiegelschicht 15 versehenes Nd:YVO4 verwendet, das mit 9' über eine Kombination von Pumpdiode achromatischen Linsen 10' gepumpt wird. Die Pulsauskopplung erfolgt über ein elektro-optisches Element 1' und einen 30 Dünnschichtpolarisator 4', Die Modenkopplung wird durch einen sättigbar absorbierenden Spiegel 14' bewirkt. Die Kavität wird durch einen gekrümmten Spiegel 16 gefaltet.

Im Gegensatz zum Femtosekunden-Lasersystem der Fig.1 kann auf ein Dispersionsmanagement verzichtet werden, so dass keine Folge von dispersiven Spiegelelementen notwendig ist.

5

10

15

20

25

den Verlauf der Pulsenergie Fig.4 zeigen Fig.3 innerhalb der Kavität in Zeitabhängigkeit. Durch das erfindungsgemäße Lasersystem können Repetitionsraten der Auskopplung bis über 1MHz erzielt werden, wobei der Kontrast zwischen ausgekoppelten Pulsen und den schwachen Hintergrund-Pulsen besser als 1:1000 ist. Als Pulsenergien werden mehr als 400 nJ erreicht, was Pulsspitzenleistungen von mehr als 1 MW entspricht. Die spektrale Breite des Ausgangs liegt bei 4 nm und die Dauer der ausgekoppelten was durch Autokorrelation 300 fs, Pulse beträgt ca. bestimmt wurde. Damit resultiert ein Zeit-Bandbreiten-Produkt von 0,33, was nahe an der Fourier-Grenze liegt. Fig.3 und Fig.4 zeigen typische Verläufe der Relaxation zwischen den Pulsauskopplungen. Fig.3 zeigt den Verlauf bei einer Repetitionsrate von 15 kHz und Fig.3 bei 173 kHz. In jeder Auskopplung wieder Fig.4 wird dabei nach die erreicht, wobei Zustand stationärer Relaxationsschwingung stark gedämpft ist, was mit Soliton-Pulsdynamik erklärt werden kann. In Fig.4 erfolgt Aufbaus des während Auskopplung noch Strahlungsfeldes und damit vor Erreichen eines stationären Zustands.

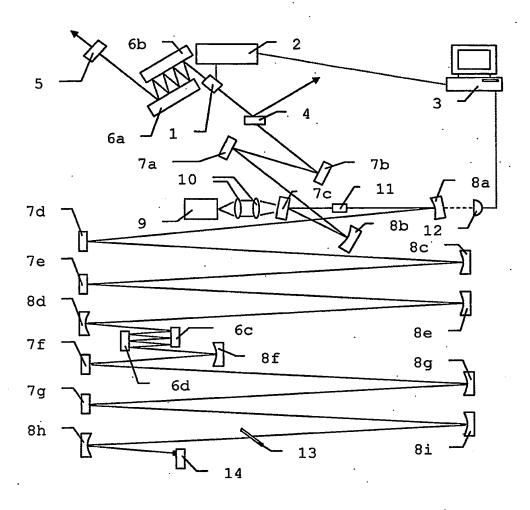
In Fig.5 erfolgt die Darstellung der Pulsevolution 30 innerhalb der Kavität für eine Repetitionsfrequenz von 1 MHz in einer Pikosekunden-Anordnung mit einem Nd:Vanadat Laser mit EOM. Die Pulsevolution ist als Funktion der Zeit und bzgl. eines Bezugswertes normiert aufgetragen.

Dargestellt sind die einzelnen Auskoppelvorgänge und der nachfolgende Pulswiederaufbau. Der Auskoppelgrad beträgt ca. 40% und die dabei ausserhalb der Kavität gemessene Pulsenergie beträgt ca. 1.7 µJ.

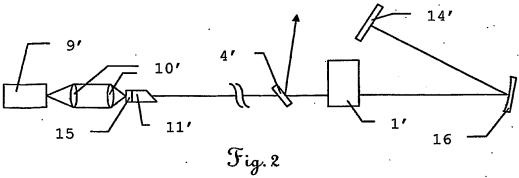
5

Die Pulsevolution nach Auskopplung und damit ausserhalb der Kavität wird für dieses Beispiel in Fig.6 dargestellt.

- Fig.7 zeigt die Darstellung der Pulsevolution innerhalb der 10 Kavität für eine Repetitionsfrequenz von 100 kHz in einer Pikosekunden-Anordnung. Die Relaxationsschwingungen des Lasers zwischen den einzelnen Auskoppelvorgängen sind deutlich zu erkennen.
- 15 In Fig.8 wird der Verlauf der ausgekoppelten Energie in Abhängigkeit von der Frequenz der Auskopplung für den Pikosekunden-Fall dargestellt. Die beobachtete Überhöhung bei ca. 400 kHz korrespondiert dabei mit dem ersten Maximum der Relaxationsschwingung, welche sich bei dieser 20 Auskoppelfrequenz einstellt.
- Es versteht sich, dass die dargestellten Lasersysteme bzw. Laseranordnung nur Ausführungsbeispiele von realisierbaren Ausführungsformen erfindungsgemäss darstellen und der Fachmann alternative Realisierungsformen 25 z.B. Verwendung anderer Laseraufbaus, unter des Resonatorkomponenten oder Resonatoranordnungen, Pumpverfahren, wie z. B. Scheibenlaser (Thin-Disk-Laser), ableiten kann. Insbesondere ist es möglich, die Schaltund/oder Regelelemente über die angegebenen Beispiele 30 hinaus anders zu gestalten, beispielsweise durch Verwendung alternativer dispersiver Komponenten, Lasermedien oder anderer elektro-optischer Elemente, welche auch höhere Repetitionsraten realisierbar machen.







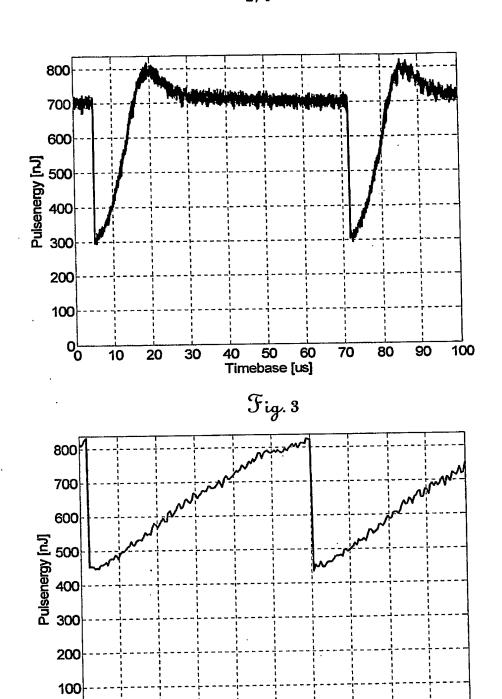
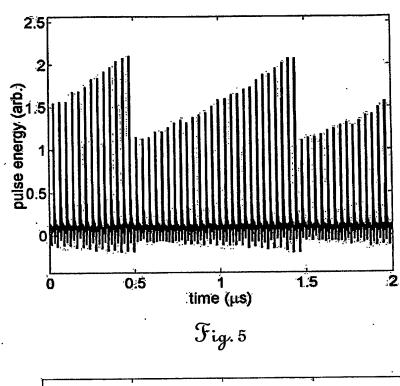
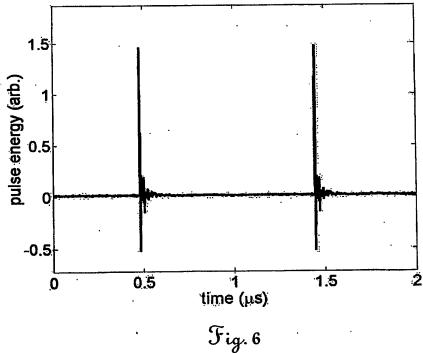


Fig.4

4 5 6 Timebase [us]





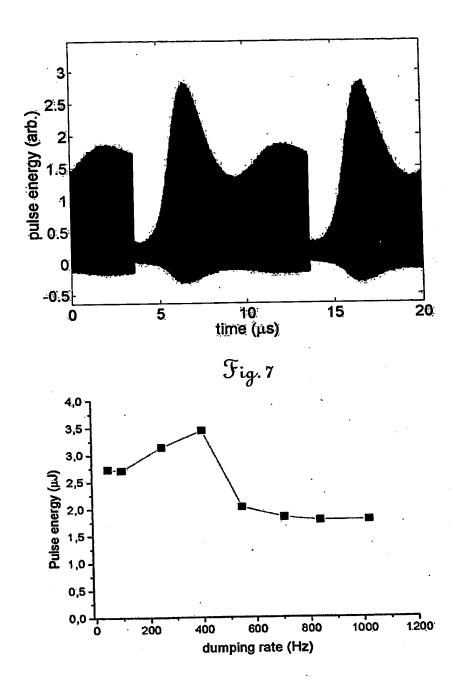


Fig. 8

BEST AVAILABLE COPY